

## Referencia

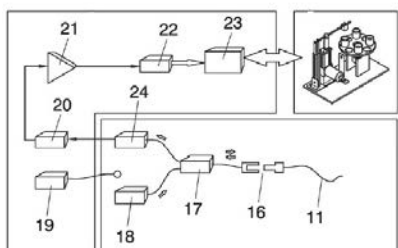
P-201001

## Propiedad industrial

Patente concedida (2014)

## Alcance geográfico

Patente Española



Esquema del sistema de deposición  
ESA con espesor controlado

## Contacto

Universidad Pública de Navarra  
Campus Arrosadía  
Edificio de Rectorado  
31006 Pamplona  
servicio.investigacion@unavarra.es  
948169782

## Cartera de ofertas

<http://www.unavarra.es/investigacion/grupos-de-investigacion-y-oferta-cientifica-y-tecnologica/cartera-de-ofertas-patentes-y-tecnologias>

## Fabricación automática de películas nanoestructuradas con control del espesor en tiempo real

La invención consiste en un sistema robótico automatizado para la deposición de películas de espesor nanométrico mediante el método de autoensamblado electrostático permitiendo el control del espesor de la nanopelícula a tiempo real

### Utilidad y aspectos innovadores

Se utiliza un sistema de deposición de películas nanoestructuradas mediante el método de autoensamblado electrostático capa a capa adaptado para controlar el número de iteración y tiempo que el objeto a recubrir permanece inmerso en cada uno de los depósitos aniónico, catiónico y de lavado. Mediante el sistema propuesto se aumenta el control y se monitoriza a tiempo real el espesor de la nanopelícula durante el proceso de deposición empleando un sistema basado en fibra óptica a tiempo real con un bajo coste tanto de uso como de inversión de equipamiento. El aumento en el control mejora además la uniformidad de los lotes de fabricación y el sistema puede utilizarse sobre distintas superficies.

### Ámbitos de aplicación

- Fabricación de materiales nanoestructurados con aplicaciones en medicina, medioambiente, electrónica, mecánica...
- Diseño y fabricación de recubrimientos nanoestructurados
- Diseño y fabricación de nuevos materiales
- Diseño y fabricación de materiales biocompatibles

### Estado de la oferta

Disponible para transferencia por medio de licencia de explotación